2-3-3

ELID搭載ラップ研削

ヒカリオン®・ラップ研削盤Ⅲ型
(HOM-380E)

〔概　要〕

本機は、ELID（電解インプロセスドレッシング）装置を搭載したラップ研削盤で、理化学研究所との共同開発された製品です。

〔特　長〕

1）片面ラップ、両面ラップ研削が可能です。
2）一定圧での研削（圧力転写型加工）や強制切込みによる研削が可能（運動転写型加工）です。
3）ワークの保持に真空チャックを採用、ワークの着脱が容易です。

〔仕　様〕

項　目 ／ 製品名	ヒカリオン®・ラップ研削盤Ⅲ型
本体研磨方式	両面ラップ式（片面ラップも可）
研磨盤最大直径	φ250～380mm
ELIDパルス電源装置	ED-1560
上ラップ	
上ラップ電動機	三相　100V　1.5kW
研磨加工方式	定圧研磨方式　9.81～784N　強制研磨方式
最小切込設定値	0.01μm
キャリヤ（ワーク）の大きさ	最大φ65mm　3個掛け
上ラップ（ワーク）回転数	0～4,000r/min
上ラップ定盤最大直径	φ250～380mm
真空チャック	オプション
下ラップ	
下ラップ電動機	三相　200V　1.5kW
下ラップ回転数	0～1,000r/min
下ラップ定盤最大直径	φ250～380mm
真空チャック	オプション
送り機構（上軸）	
送りモータ	三相　200V　25W
送り速度	50mm/min
機体寸法	W910×L1,000×H1,850mm
機体質量	1,200kg
ラップ定盤	φ250～380mm（片面、両面兼用）

〔ヒカリオンラップ研削盤の研削加工形態〕

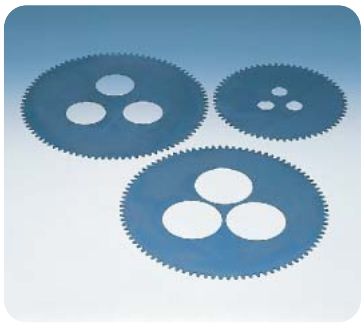
1）高能率研削……粗粒メタルボンド砥石を用いた強制研削
2）鏡面研削……微細砥粒メタルボンド（またはメタルーレジンボンド）砥石を用いた定圧研削
3）超精密研削……超微細砥粒メタルーレジンボンド砥石を用いた定圧研削
4）大型ワークの研削……カップ砥石を用いた強制研削または定圧研削

※カップ砥石径は別途問合せ下さい。



（HOM-380E）





［ELID両面ラップ研削の原理図］

